

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 2 月 11 日(11.02.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/021532 A1

- (51) 国際特許分類:
G02B 5/26 (2006.01) *B32B 15/01* (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01) *G02B 5/22* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/071921
- (22) 国際出願日: 2015 年 8 月 3 日(03.08.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-159889 2014 年 8 月 5 日(05.08.2014) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 中西 陽介(NAKANISHI, Yosuke); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 渡邊 聖彦(WATANABE, Masahiko); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 大森 裕(OHMORI, Yutaka); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 新宅 将人, 外(SHINTAKU, Masato et al.); 〒5410054 大阪府大阪市中央区南本町 4 丁目 5

ー 7 東亜ビル いざなぎ国際特許事務所
Osaka (JP).

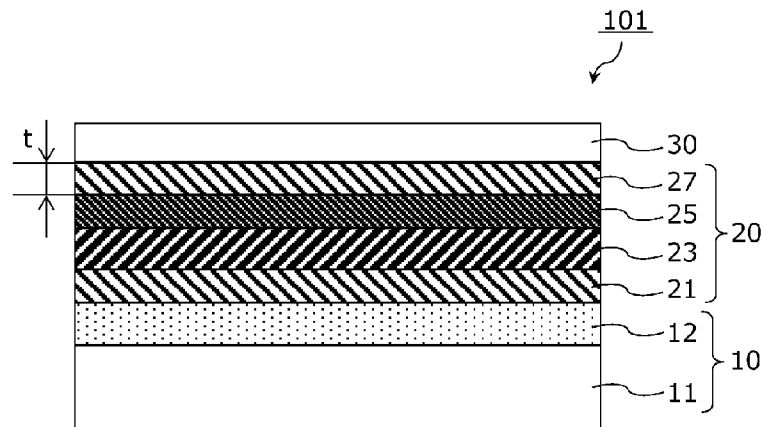
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: INFRARED REFLECTING SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 赤外線反射基板



(57) Abstract: This infrared reflecting substrate (100) is provided, on a transparent film base (10), an infrared reflecting layer (23) and a light absorptive metal layer (25) in this order, said infrared reflecting layer (23) being mainly composed of silver. The light absorptive metal layer (25) has a film thickness of 15 nm or less, and a transparent protective layer (30) has a film thickness of from 10 nm to 120 nm. The distance between the light absorptive metal layer (25) and the transparent protective layer (30) is 25 nm or less. An infrared reflecting substrate having low visible light reflectance, excellent visibility and excellent productivity is provided by the present invention.

(57) 要約: 赤外線反射基板 (100) は、透明フィルム基材 (10) 上に、銀を主成分とする赤外線反射層 (23)、および光吸収性金属層 (25) をこの順に備える。光吸収性金属層 (25) の膜厚は 15 nm 以下であり、透明保護層 (30) の膜厚は 10 nm ~ 120 nm である。光吸収性金属層 (25) と透明保護層 (30) との間隔は、25 nm 以下である。本発明により、可視光反射率が低く視認性に優れ、かつ生産性に優れる赤外線反射基板が提供される。



WO 2016/021532 A1